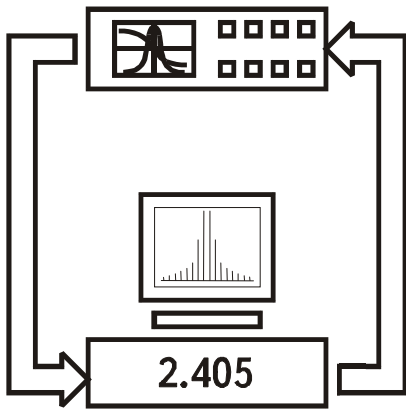
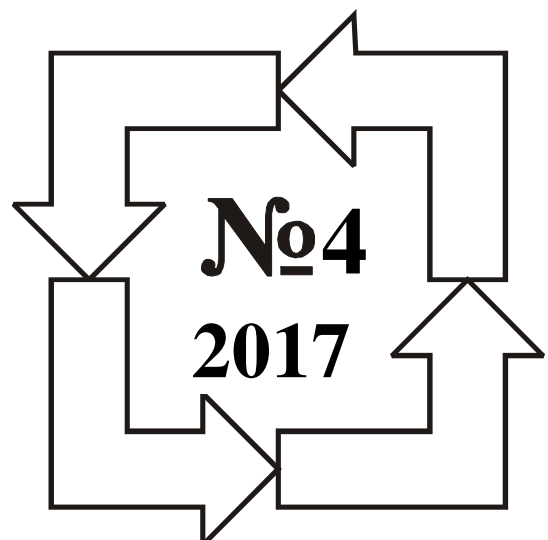


ISSN 2219-9365



*МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ*

**ВИМІРЮВАЛЬНА
ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА
ТЕХНІКА
В
ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСАХ**



ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Міжнародний науково-технічний журнал

ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Заснований в травні 1997 р.

Виходить 4 рази на рік

Хмельницький, 2017, №4 (60)

Засновники: Хмельницький національний університет
Українська технологічна академія, м. Київ
Видавець: Українська технологічна академія

Затверджене як фахове видання постановою президії ВАК України від 10.02.2010 № 1-05/1

Журнал з 2015 року має високий Імпакт-фактор:

Включено у РИНЦ (дог. № 212-04/2013)

Index Copernicus

Google Scholar

Національна бібліотека України

ім. В.І. Вернадського

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37653

<http://iml2012.indexcopernicus.com/p24781565.3.html> h-індекс 49,97

http://scholar.google.com.ua/citations?user=nwN_nusAAAAJ&hl=uk

<http://nbuv.gov.ua/j-tit/vott> h-індекс 9

Головний редактор д.т.н., проф. І.В. Троцишин

**Заступник головного редактора та
голова редакційної колегії
Відповідальний секретар** д.т.н., проф. В.Т. Кондратов

Редакційна колегія:

Бубулис Алгимантас, д.т.н., проф. (Литва); Вільям Кей Джі, д.т.н., проф., (Республіка Корея);
Водотовка В.І., д.т.н., проф.; Дивак М.П., д.т.н., проф.; Дудикевич В.Б., д.т.н., проф.; Жултовський
Богдан, д.т.н., проф. (Польща); Борботько Т.В., д.т.н., проф. (Білорусія); Здоренко В.Г., д.т.н., проф.;
Злепко С.М., д.т.н., проф.; Каплун В.Г., д.т.н., проф.; Кичак В.М., д.т.н., проф.; Коробко С.В., д.т.н.,
проф. (Білорусія); Косенков В.Д., к.т.н., проф.; Кузьмін І.В., д.т.н., проф.; Лепіх Я.І., д.ф-м.н., проф.;
Мансуров Тофік Магомедович, д.т.н., проф. (Азербайджан); Мельник А.О., д.т.н., проф.; Натріашвілі
Тамаз Мамієвич, д.т.н., проф. (Грузія); Павлов С.В., д.т.н., проф.; Підченко С.К., д.т.н., проф.; Попов
Валентин, д. природничих н., проф. (Німеччина); Пунченко О.П., д.філ.н., проф.; Ройзман В.П., д.т.н.,
проф.; Романюк В.В., д.т.н., проф.; Романюк О.Н., д.т.н., проф.; Ротштейн О.П., д.т.н., проф. (Ізраїль);
Себко В.В., д.т.н., проф.; Сопрунюк П.М., д.т.н., проф.; Стахов О.П., д.т.н., проф. (Канада); Стенцель
Й.І., д.т.н., проф.; Сурду М.М., д.т.н., проф.; Туз Ю.М., д.т.н., проф.; Цветков В.Ю., д.т.н., проф.
(Білорусія); Шарпан О.Б., д.т.н., проф.; Шевченко К.Л., д.т.н., проф.

Технічний редактор І.В. Троцишин

Адреса редакції: редакція журналу "Вимірювальна та обчислювальна техніка в
технологічних процесах", (кімн. 4-402), Хмельницький національний
університет, вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, Україна.

Тел: (+380) 97-684-3429.

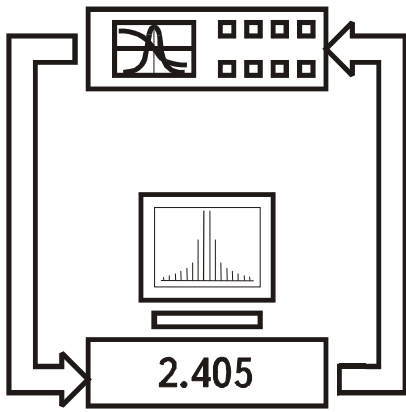
E-mail: vottt.tiv@gmail.com

web: <http://fetronics.ho.com.ua>

Зареєстровано Міністерством юстиції України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №16040-4512ПР від 16 грудня 2009 року.

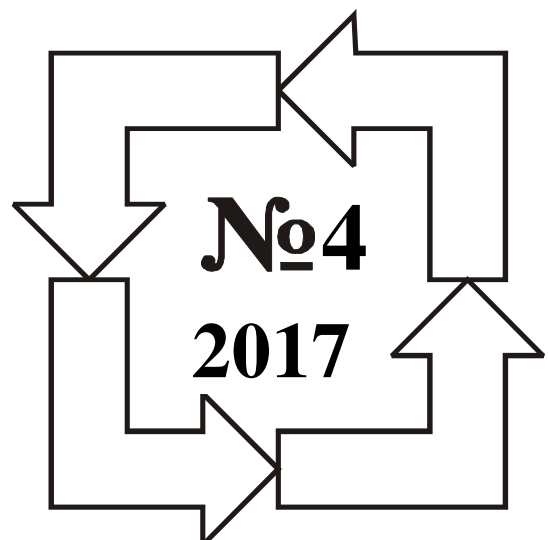
© Українська технологічна академія, 2017
© Редакція "Вимірювальна та обчислювальна
техніка в технологічних процесах", 2017

ISSN 2219-9365



*INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-TECHNICAL
MAGAZINE*

**MEASURING
AND
COMPUTING
DEVICES
IN
TECHNOLOGICAL
PROCESSES**



KHMELNITSKY

International scientific-technical magazine

MEASURING AND COMPUTING DEVICES IN TECHNOLOGICAL PROCESSES

Founded in 1997 May

Published 4 times in a year

Khmelnitsky, 2017, №4 (60)

Founders Khmelnytsky national university, Khmelnytsky, Ukraine
Ukrainian Technological Academy, Kyiv, Ukraine
Publisher Ukrainian Technological Academy

Approved as a professional publication the decision
of Higher Attestation Commission
at 10.02.2010, № 1-05/1

http://vak.org.ua/docs//prof_journals/journal_list/whole.pdf

Approved as a professional publication

The decision of Higher Attestation Commission, 10.02.2010, № 1-05/1

The magazine in 2015 is the most influential factor in the world:

Included in Russian Index of Scientific
Citations (№ 212-04/2013)
Index Copernicus
Google Scholar
National library of Ukraine named after
V.I. Vernadsky (Kyiv, Ukraine)

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37653

http://jmi2012.indexcopernicus.com/p24781565_3.html **h-indeks 49,97**

http://scholar.google.com.ua/citations?user=nwN_nusAAAAJ&hl=uk

<http://nbuv.gov.ua/j-tit/vott> **h-indeks 9**

Chief Editor Ivan V. Trotsyshyn, prof., doctor of science
Deputy Editor and Chairman of Editorial Board V.T. Kondratov, prof., doctor of science
Executive Secretary

Editorial board:

Algimantas Bubulis, prof. (Lithuania); **Borbotko T.V.**, prof. (Belarus); **Vilyam Kay Dzhi**, prof., (Republic of Korea); **Vodotovka V.I.**, prof.; **Divak M.P.**, prof.; **Dudikevich V.B.**, prof.; **Kaplun V.G.**, prof.; **Kychak V.M.**, prof.; **Korobko E.V.**, prof. (Belarus); **Kosenkov V.D.**, prof.; **Kuzmin I.V.**, prof.; **Lepih YA.I.**, prof.; **Mansurov Tofik Magomedovich**, prof. (Azerbaijan); **Melnik S.A.**, prof.; **Natriashvili Tamaz Mamievich**, prof. (Georgia); **Pavlov S.V.**, prof.; **Pidchenko S.K.**, prof.; **Popov Valentin**, prof. (Germany); **Punchenko O.P.**, prof.; **Roizman V.P.**, prof.; **Romaniuk V.V.**, prof.; **Romanyuk O.N.**, prof.; **Rothstein Oleksandr Petrovich**, prof. (Israel); **Soprunyuk P.M.**, prof.; **Sebko V.V.** prof., **Stakhov Olexiy Petrovic**, prof. (Canada), **Stenzel Y.I.**, prof.; **Surdu M.M.**, prof.; **Tuz Yu.M.**, prof.; **Tsvetkov V.Yu.**, prof. (Belarus); **Sharpan O.B.**, prof., **Shevchenko K.L.**, prof.; **Zhultovsky Bogdan**, prof. (Poland); **Zdorenko V.G.** prof., **Zlepko S.M.**, prof.

Technical editor **I. V. Trotsyshyn**

Address of editorial office: *editorial office of magazine "Measuring and Computing Devices in Technological Processes", Khmelnytsky national university, Ukraine, 29016, Khmelnytsky, 11 Institutyska str., (4-402 room),*

phone: (+380) 97-684-3429 (Russian, Ukrainian)

E-mail: vottp.tiv@gmail.com (Russian, Ukrainian, English)

web: <http://fetronics.ho.com.ua>

Subscribed by Ministry of Justice of Ukraine
Certificate about governmental registration of publishing means of mass information
Series "KV" №16040-4512PR, December ,16, 2009.

© **Ukrainian Technological Academy, 2017**
© **Magazine "Measuring and Computing
Devices in Technological Processes", 2017**